4Pa47

炭素分子イオン源から引き出されるイオンビーム空間分布の測定 Measurement of Ion Beam Spatial Distribution Extracted from a Carbon Molecular Ion Source

<u>安藝 基1</u>, 今村 勇太², 冨田 健介¹, 宮本 直樹², 和田 元² <u>Hajime Aki¹</u>, Yuta Imamura², Kensuke Tomita¹, Naoki Miyamoto² and Motoi Wada²

> ¹同志社大学理工学部 ²同志社大学大学院理工学研究科 ¹Faculty of Science and Engineering, Doshisha University ²Graduate School of Science and Engineering, Doshisha University

1. 研究概要

多原子分子イオンビームのイオン種及びビーム 電流値を制御できる可能性から、イオン源プラズ マ中でクラスター生成・イオン化する方法を検討 している.そこで、Fig.1に示すデュオプラズマト ロン型イオン源を設計製作し、炭素ホローカソー ドプラズマによる炭素分子イオン生成を調査して いる.



Fig. 1. A schematic diagram of the duoplasmatron type ion source with the hollow cathode.

2. 実験装置

実験系の概略図を Fig. 2 に示す. 高さ 200 mm, 直径 100 mm の小型デュオプラズマトロン型イオ ン源は,排気能力 750 ℓ/s の TMP で真空排気され たチャンバーに取り付けられる. プラズマは,内 径 8 mm,ガス噴出部が直径 2 mm,先端角度 45° の炭素ホローカソードと中心孔径 0.5 mm の陽極 間で維持され,直径 3 mm,長さ 6 mm の中間電極 中心孔における約 4 kG の磁力によって圧縮し,高 密度化される. 今回試験したデュオプラズマトロ ン型イオン源は,90 W 以上の大放電電力下や十分 にイオン源を冷却していない条件下での実験にお いて,引き出し電極間での直接放電が生じ,イオ ン源の運転が制限された. イオン源から引き出さ れたイオンビームを,引き出し電極孔から約 140 mm後方に設置されている開口部 1×24 mmの可動 式のファラデーカップによって電流値として検出 することで、ビーム引き出し領域のイオンシース 形状の検討及びイオン源評価を行う.



Fig. 2. A schematic diagram of the experimental set up.

3. 実験結果

イオン源から引き出されたイオンビーム電流の 空間分布を Fig. 3 に示す.引き出し電圧を増加さ せるに従い,イオンビーム中心の電流密度は大き く増加し,それに伴いビーム電流分布の半値幅は 小さくなる結果が得られた.現在,詳細なイオン ビームの空間分布の変化と,引き出しパラメータ との相関を調査中である.



Fig. 3. Ion beam current spatial distribution extracted from the ion source for various extraction voltages.